# (19)日本図特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-15457

(P2002-15457A)

(43)公開日 平成14年1月18日(2002.1.18)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G11B 7/22

7/135

G 1 1 B 7/22

5D119

7/135

Z Α

## 審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特願2000-196543(P2000-196543)	(71)出願人	000204284
(0.0) .t	M. Dag by a magning (asset a sec		太陽誘電株式会社
(22)出顧日	平成12年6月29日(2000.6.29)		東京都台東区上野6丁目16番20号
		(72)発明者	松田 熟
			東京都台東区上野 6 丁目16番20号 太陽誘
			電株式会社内
		(72)発明者	砂川 隆一
			東京都台東区上野6丁目16番20号 太陽誘
			電株式会社内
		(74)代理人	100071054
			弁理士 木村 高久
		ı	

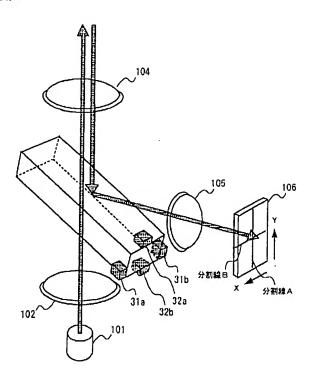
最終頁に続く

## (54)【発明の名称】 光ピックアップの光軸調整方法および装置

#### (57)【要約】

【課題】 光ピックアップ組立時の光軸調整マージンを 広げ、かつ、記録または再生時の外乱による光軸ずれを 抑制して記録再生特性の向上を図る。

【解決手段】 直方体形状のビームスプリッタ103の 側面に、互いに異なる方向に駆動される2対の圧電素子 31a、31bおよび32a、32bをそれぞれ配設す ることによって、光ピックアップの光軸に対するビーム スプリッタ103の位置を2軸方向に調整する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光源から光ディスクに向けて射出されたレーザビームと該光ディスクで反射されたレーザビームとを分離する光学素子と、前記光学素子により分離された前記光ディスクで反射されたレーザビームを受光する受光素子とを有する光ピックアップの光軸調整方法において

前記光学素子に該光学素子の前記レーザビームに対する 位置を少なくとも2軸方向に移動させるアクチュエータ を設け、

該アクチュエータを前記受光素子の受光面上における前記レーザビームの受光スポットの位置に対応して制御することを特徴とする光ピックアップの光軸調整方法。

【請求項2】 前記受光素子は、2次元フォトディテクであり、

該2次元フォトディテクの中心位置に前記レーザビームの受光スポットが位置するように前記アクチュエータをフィードバック制御することを特徴とする請求項1記載の光ピックアップの光軸調整方法。

【請求項3】 前記光学素子は、直方体形状のビームス 20 プリッタ若しくはハーフミラーであり、

前記アクチュエータは、前記直方体形状のビームスプリッタ若しくはハーフミラーの対向する面にそれぞれ配設され、互いに異なる方向に駆動される少なくとも2対の電歪素子を含むことを特徴とする請求項1記載の光ピックアップの光軸調整方法。

【請求項4】 前記電歪素子は、圧電素子であることを 特徴とする請求項3記載の光ピックアップの光軸調整方 注

【請求項5】 光源から光ディスクに向けて射出された 30 レーザビームと該光ディスクで反射されたレーザビーム とを分離する光学素子と、前記光学素子により分離された前記光ディスクで反射されたレーザビームを受光する 受光素子とを有する光ピックアップの光軸調整装置において.

前記光学素子に該光学素子の前記レーザビームに対する 位置を少なくとも2軸方向に移動させるアクチュエータ と...

前記アクチュエータを前記受光素子の受光面上における 前記レーザビームの受光スポットの位置に対応して制御 40 する制御手段とを具備することを特徴とする光ピックア ップの光軸調整装置。

【請求項6】 前記受光素子は、

2次元フォトディテクであり、

前記制御手段は、

前記2次元フォトディテクの中心位置に前記レーザビームの受光スポットが位置するように前記アクチュエータをフィードバック制御することを特徴とする請求項5記載の光ピックアップの光軸調整装置。

【請求項7】 前記光学素子は、

2

直方体形状のビームスプリッタ若しくはハーフミラーで あり、

前記アクチュエータは、

前記直方体形状のビームスプリッタ若しくはハーフミラーの対向する面にそれぞれ配設され、互いに異なる方向 に駆動される少なくとも2対の電歪素子を含むことを特 徴とする請求項5記載の光ピックアップの光軸調整装 置。

【請求項8】 前記電歪素子は、圧電素子であることを 10 特徴とする請求項7記載の光ピックアップの光軸調整装 置

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、光ピックアップの光軸調整方法および装置に関し、特に、光ピックアップの光軸ずれをリアルタイムに補正することで光ピックアップの製造時のマージンを広げ、光ピックアップの生産コストを低減することを可能にした光ピックアップの光軸調整方法および装置に関する。

[0002]

【従来の技術】図5は、従来の光ピックアップを模式化 して示す構成図である。

【0003】図5において、レーザーダイオード101から出射したレーザビームは、コリメートレンズ102により平行光とされ、ビームスプリッタ103を透過して対物レンズ104で収束されて光ディスク2の記録面の記録トラック上を照射する。

【0004】なお、対物レンズ104はトラッキング方向およびフォーカシング方向に移動可能に構成され、対物レンズ104の位置は、図示しないトラッキングサーボ系およびフォーカシングサーボ系によりフィードバック制御されている。

【0005】光ディスク2の記録面において反射されたレーザビームは、光ディスク2の記録トラックに記録されていた情報を含み、再び対物レンズ104を経由してビームスプリッタ103で側方に反射され、集光レンズ105を介してフォトディテクタ106で電気信号に変換され、変換された電気信号から所望の情報の再生信号が検出される。

」【0006】また、上記電気信号からは上記トラッキングサーボ系によるトラッキングフィードバック制御のためのトラッキングエラー信号や上記フォーカシングサーボ系によるフォーカシングフィードバック制御のためのフォーカスエラー信号等が検出される。

【0007】ところで、このような光ピックアップでは、上記の光学部品の光軸を揃えるため、組立時に組立精度調整等の調整作業を行う必要がある。

[8000]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記のような 50 光ピックアップは、部品点数が多いために調整作業が複

雑になり、かつ精度が要求されるので調整作業に時間を 要する。

【0009】したがって、部品精度に依存する組立工法 では、初期的な光軸ずれを抑えることが困難で、光ピッ クアップの量産化を図る上での問題となっていた。

【0010】そこで、この発明は、光ピックアップの組 立時における光軸調整マージンを広げて生産コストを低 下させ、かつ、使用時における光ディスクの偏芯、面ぶ れ等による光軸ずれを抑え、さらに、光ピックアップの ックアップの光軸調整方法および光ピックアップを提供 することを目的とする。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する ため、この発明は、光源から光ディスクに向けて射出さ れたレーザビームと該光ディスクで反射されたレーザビ 一ムとを分離する光学素子と、前記光学素子により分離 された前記光ディスクで反射されたレーザビームを受光 する受光素子とを有する光ピックアップの光軸調整方法 において、前記光学素子に該光学素子の前記レーザビー 20 ムに対する位置を少なくとも2軸方向に移動させるアク チュエータを設け、該アクチュエータを前記受光素子の 受光面上における前記レーザビームの受光スポットの位 置に対応して制御することを特徴とする。

【0012】ここで、前記受光素子は、2次元フォトデ ィテクタであり、該2次元フォドディテクタの中心位置 に前記レーザビームの受光スポットが位置するように前 記アクチュエータをフィードバック制御する。

【0013】なお、前記アクチュエータの制御は、フィ ードバック制御に限らず、フィードフォワード等の他の 30 れている。 制御手段によって制御することも可能である。

【0014】また、前記光学素子は、直方体形状のビー ムスプリッタ若しくはハーフミラーであり、前記アクチ ュエータは、前記直方体形状のビームスプリッタ若しく はハーフミラーの対向する面にそれぞれ配設され、互い に異なる方向に駆動される少なくとも2対の電歪素子を

【0015】なお、前記電歪素子としては、例えば圧電 素子が適用できる。

【0016】また、この発明は、光源から光ディスクに 40 向けて射出されたレーザビームと該光ディスクで反射さ れたレーザビームとを分離する光学素子と、前記光学素 子により分離された前記光ディスクで反射されたレーザ ビームを受光する受光素子とを有する光ピックアップの 光軸調整装置において、前記光学素子に該光学素子の前 記レーザビームに対する位置を少なくとも2軸方向に移 動させるアクチュエータと、前記アクチュエータを前記 受光素子の受光面上における前記レーザビームの受光ス ポットの位置に対応して制御する制御手段とを具備する ことを特徴とする。

【0017】ここで、前記受光素子は、2次元フォトデ ィテクタであり、前記制御手段は、前記2次元フォトデ ィテクタの中心位置に前記レーザビームの受光スポット が位置するように前記アクチュエータをフィードバック 制御する。

【0018】さらに、前記光学素子は、直方体形状のビ ームスプリッタ若しくはハーフミラーであり、前記アク チュエータは、前記直方体形状のビームスプリッタ若し くはハーフミラーの対向する面にそれぞれ配設され、互 経年劣化による光軸ずれをも補正することのできる光ピ 10 いに異なる方向に駆動される少なくとも2対の電歪素子 を含む。

> 【0019】なお、前記電歪素子としては、例えば圧電 素子が適用できる。

[0020]

【発明の実施の形態】以下、この発明に係わる光ピック アップの光軸調整方法および光ピックアップの実施の形 態を添付図面を参照して詳細に説明する。

【0021】図1は、この実施の形態の光ピックアップ の概略構成を示す図である。

【0022】図1において図5と同じ参照数字を付した ものは図5と同じ構成要素を示すので説明を省略する。 【0023】図1に示す光ピックアップにおいて、直方 体形状のビームスプリッタ103は、対向する一組の側 面に圧電素子31a、31b、対向するもう一組の側面 に圧電素子32a、32bをそれぞれに具備し、図示し ない光ディスクからの反射光がフォトディテクタ106 の受光面に形成する受光スポットの位置を直交する2軸 方向、つまり、光ディスクの記録トラックに平行な方向 と半径方向に平行な方向とに移動調整できるよう構成さ

【0024】なお、フォトディテクタ106は、図示し ない光ディスクのトラック方向、半径方向のそれぞれに 対応して2分割された4分割フォトディテクタであり、 この発明の光軸調整は、光ディスクからの反射光がフォ トディテクタ106上に形成する受光スポットの位置 を、常にフォトディテクタ106の分割中央の位置に合 わせることを目的としている。

【0025】図2、図3は、圧電素子31a、31bお よび32a、32bに電気信号を印加し、圧縮もしくは 伸張させ、ビームスプリッタ103への図示しない光デ ィスクからの反射光の入射角を調整することによって、 反射光がフォトディテクタ106上に形成する受光スポ ットの位置をX軸方向、Y軸方向のそれぞれに調整する 様子を示している。

【0026】図2(a)および図2(b)は、圧電素子 32aおよび32bに電気信号を印加し、それぞれの圧 電素子を圧縮もしくは伸張させることにより、光ディス クからの反射光がフォトディテクタ106の受光面に形 成する受光スポットのY軸方向のずれが補正される様子 50 を示す。

【0027】図2 (a) のように、圧電素子32aを伸 張して圧電素子32bを圧縮した場合、ビームスプリッ タ103は図示しない光ディスクからの反射光の入射角 が大きくなる方向に首を振るため、かかる反射光がフォ トディテクタ106の受光面に形成する受光スポットは 同図においてフォトディテクタ106のY軸方向上側に 移動する。

【0028】逆に、図2(b)のように、圧電素子32 a を圧縮し、圧電素子32bを伸張した場合、ビームス プリッタ103は図示しない光ディスクからの反射光の 10 入射角が小さくなる方向に首を振るため、かかる反射光 がフォトディテクタ106の受光面に形成する受光スポ ットは同図においてフォトディテクタ106のY軸方向 下側に移動する。

【0029】同様に、図3(a)および図3(b)は、 圧電素子31aおよび31bに電気信号を印加し、それ ぞれの圧電素子を圧縮もしくは伸張させることにより、 光ディスクからの反射光がフォトディテクタ106の受 光面に形成するスポットのX軸方向のずれが補正される 様子を示す。

【0030】図3 (a) のように、圧電素子31aを圧 縮し、圧電素子31bを伸張した場合、同図において紙 面表側からビームスプリッタ103に入射した図示しな い光ディスクからの反射光がフォトディテクタ106の 受光面に形成する受光スポットは、フォトディテクタ1 06のX軸方向右側に移動する。

【0031】図3(b)のように、圧電素子31aを伸 張し、圧電素子31bを圧縮した場合、同図において紙 面表側からビームスプリッタ103に入射した図示しな い光ディスクからの反射光がフォトディテクタ106の 30 2) 光ディスクの偏芯、面ぶれによる光軸ずれ 受光面に形成する受光スポットは、フォトディテクタ1 06のX軸方向左側に移動する。

【0032】ここで、各圧電素子に印加する電気信号 は、次のように生成される。

【0033】図4は、各圧電素子を制御する制御回路の 概略構成を示すブロック図である。

【0034】図4に示すように、フォトディテクタ10 6は、光ディスクのトラック接線方向と光学的に平行な 分割線A、および光ディスクの半径方向と光学的に平行 な分割線Bによって4分割され、4つの受光領域A、 B、C、Dを有する2次元4分割フォトディテクタであ

【0035】ここで、光ディスクからの反射光がフォト ディテクタ106の受光面に形成する受光スポットの位 置の情報は、かかるフォトディテクタ106の各受光領 域から出力される信号を用いて以下の演算を行うことに より得られる信号SxおよびSyで定義できる。

[0036] S x = (A+C) - (B+D)Sy = (A+B) - (C+D)

なお、光ディスクからの反射光がフォトディテクタ10 50 に干渉することはない。

6 の分割線Aおよび分割線Bの交点上に受光スポットを 形成していれば、Sx=0、Sy=0となる。

【0037】ところが、光ディスクからの反射光がフォ トディテクタ106の受光面に形成する受光スポットの 中心が、分割線A上からX軸方向左側にずれると(図3 (a) の破線で示すスポットに対応する)、信号Sxは プラスの値を持ち、X軸方向右側にずれると(図3

- (b) の破線で示すスポットに対応する)、信号Sxは マイナスの値を持つ。
- 【0038】同様に、光ディスクからの反射光がフォト ディテクタ106の受光面に形成する受光スポットの中 心が、分割線 B 上から Y 軸方向下側にずれると (図 2
  - (a) の破線で示すスポットに対応する)、信号Syは マイナスの値を持ち、Y軸方向上側にずれると(図2
  - (b) の破線で示すスポットに対応する)、信号Syは プラスの値を持つ。

【0039】したがって、かかる信号Sxおよび信号S yに基づいて、X軸方向制御部31およびY軸方向制御 部32において各圧電素子に印加すべき信号を生成す

【0040】つまり、信号Sxおよび信号Syの値がゼ ロになるように、4つの圧電素子を圧縮もしくは伸張さ せて図示しない光ディスクからの反射光がフォトディテ クタ106の受光面に形成する受光スポットの位置を調 整する。

【0041】ここで、光軸ずれの要因として、大きく次 の3つが考えられる。

【0042】1) 光ピックアップの組立時における初 期的な光軸ずれ

- 3) 光ディスク装置の使用環境による外乱
- 1) の要因による光軸ずれは、部品精度や部品の取付精 度による定常的なものである。したがって、このような 初期的な光軸ずれを補正するための信号を予め測定して メモリ30に記憶させておけば、X軸方向制御部31お よびY軸方向制御部32は単にメモリ30に記憶された 信号を各圧電素子に印加するだけで、直ちに1)の要因 による光軸ずれを解消できる。

【0043】一方、2) および3) の要因による光軸ず 40 れの補正は、リアルタイムに制御する必要がある。

【0044】つまり、X軸方向制御部31およびY軸方 向制御部32は、信号Sxおよび信号Syを常に監視 し、この信号SxおよびSyの変動に基づいて各圧電素 子に印加する信号をリアルタイムで生成する。

【0045】なお、受光スポットの中心がフォトディテ クタ106の分割線A上からX軸方向にどれだけずれて いるかを表す信号Sxは、トラッキングエラー信号の生 成にも用いられるが、光軸ずれ補正の周波数帯域はトラ ッキング制御の周波数帯域よりも十分に低いので、相互 7

【0046】また、上記実施例においては、ビームスプリッタを例に説明したが、ハーフミラーを用いた場合においても同様にこの発明を適用することができる。

【0047】さらに、光ピックアップの光軸に対してビームスプリッタを2軸方向に移動調整するための手段は、上記の圧電素子に限らず、電歪素子であれば適用可能である。

#### [0048]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、光ピックアップ内に配設される直方体形状のビーム 10 スプリッタ若しくはハーフミラーの対向する面に、互いに異なる方向に駆動される少なくとも2対の圧電素子をそれぞれ配設することにより、かかるビームスプリッタ若しくはハーフミラーのレーザビームに対する位置を2軸方向に移動させ、光ディスクからの反射光が受光素子の受光面に形成する受光スポットをつねに該受光面の中心に位置するように制御するので、光ピックアップ組立時の光軸調整マージンを広くでき、かつ、光ディスクの偏芯、面ぶれ、および光ディスク装置の使用環境による

外乱等の使用時における光軸ずれも補正できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

【図2】

【図3】

【図4】

【図5】

#### 【符号の説明】

2 光ディスク

30 メモリ

3 1 X軸方向制御部

32 Y軸方向制御部

3·1 a、31 b、32 a、32 b 圧電素子

101 レーザダイオード

102 コリメートレンズ

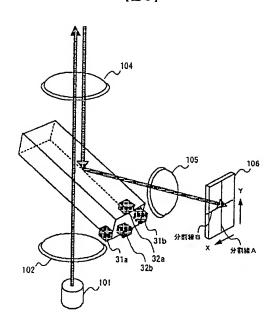
103 ビームスプリッタ

104 対物レンズ

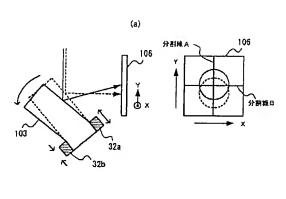
105 集光レンズ

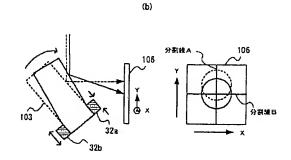
106 フォトディテクタ

[図1]

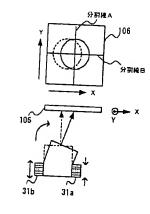


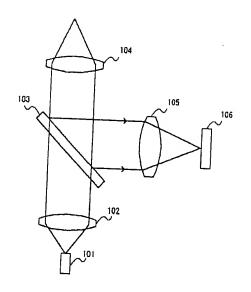
### [図2]





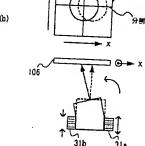




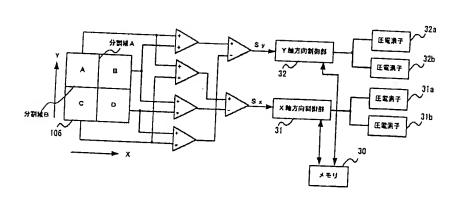


【図5】

(a)



[図4]



フロントページの続き

(72)発明者 清水 宏郎

東京都台東区上野 6 丁目16番20号 太陽誘 電株式会社内

(72) 発明者 清水 洋信

東京都台東区上野 6 丁目16番20号 太陽誘 電株式会社内

(72)発明者 関口 慎生

東京都台東区上野 6 丁目16番20号 太陽誘 電株式会社内

Fターム(参考) 5D119 AA38 AA40 BA01 EC15 JA10 JA11

